**Науменко, Эльфвра Вячеславовна. Применение математических моделей для выбора оптимальных параметров управления технологическим процессом постимплантационного отжига полупроводниковых структур : На примере InSb : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.13.16, 05.27.06 / Моск. акад. тонкой хим. технологии.- Москва, 1997.- 18 с.: ил. РГБ ОД, 9 98-3/3066-X**